Nova válvula monoflange design
também previne emissões fugitivas

Iperó, Agosto de 2019

Design compacto e potencial de vazamento minimizado: A nova válvula monoflange WIKA modelo IVM para conectar instrumentos de medição de pressão ao processo é particularmente adequado para aplicações envolvendo líquidos críticos, gases e vapores. Gaxetas especiais também evitam emissões fugitivas de acordo com TA-Luft (VDI 2440) e ISO 15848-1.

A válvula monoflange é fabricada e testada para atender a várias normas comuns, como o ASME BPVC. Ela é projetada para uma longa vida útil, mesmo sob condições difíceis. As válvulas trabalham de forma durável, suave e precisa, mesmo em altas pressões. A sede de metal da ponta do fuso não rotativa é testada quanto a estanqueidade. Para evitar falhas e vazamentos, a montagem rosqueada dos castelos não está em contato com o meio.

Em uma versão com castelo OS & Y, testada com a API API 607 e ISO 10497 / BS 6755-2, a IVM também pode ser montada diretamente no processo sem o primeiro isolamento adicional.

Para a combinação da monoflange (ou outros dispositivos de proteção) com um instrumento de medição de pressão, a WIKA oferece montagem profissional. Os clientes recebem uma solução completa específica para a aplicação ("hook-up"), pronta para instalação e testada contra vazamentos.

Número de caracteres: 1.112

Palavra-chave: Monoflange IVM

WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Ursula Wiegand, 03

18560-000 Iperó, SP

Brasil

Tel. +55 15 3459-9700

Fax +55 15 3266-1169

vendas@wika.com.br

[www.wika.com.br](http://www.wika.com.br)

Imagem corporativa WIKA:

Nova válvula monoflange com design que também previne emissões fugitivas



**Editado por:**

WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Thaís Mota e Rui Coelho

Marketing Services

Av. Ursula Wiegand, 03

18560-000 Iperó, SP

Brasil

Tel. +55 15 3459-9765

thais.mota@wika.com

[www.wika.com.br](http://www.wika.com.br)

WIKA press release 06/2019